

05; 11; 12

© 1993

ДИАГНОСТИКА ТОЧЕЧНЫХ РАДИАЦИОННЫХ ДЕФЕКТОВ С ПОМОЩЬЮ АТОМНО-СИЛОВОЙ МИКРОСКОПИИ

Е.В. Благов, Г.Л. Климчикая,
В.М. Мостепаненко, В.И. Панов,
И.Ю. Соколов

Применение метода атомно-силовой микроскопии (ACM) [1-5] к изучению поверхности облученных материалов может дать новые сведения о физике радиационных повреждений поверхности в нанометровой области. Использование данного метода обещает быть особенно плодотворным при исследовании радиационных повреждений на ранних стадиях облучения, когда радиационные дефекты невелики и трудно различимы обычными способами [6]. Таким образом, атомно-силовая микроскопия может рассматриваться как существенное дополнение к известным методам атомионной микроскопии [7], электронной микроскопии высокого разрешения [8, 9], малоуглового рассеяния рентгеновских лучей и нейтронов [10, 11], сканирующей туннельной микроскопии [12, 13], используемым для исследования радиационных повреждений материалов.

Рассмотрим вопрос о возможности наблюдения точечных дефектов методом ACM на примере вакансии. При изучении таких дефектов целесообразно выбирать режим работы ACM с наибольшим разрешением порядка единиц ангстрем. Столь высокое разрешение достигается, если сканирование острия ACM над исследуемой поверхностью осуществляется вдоль линий постоянной силы $> 10^{-8} N$.

При этом ван-дер-ваальсовым притяжением между острием и образцом можно пренебречь (оно составляет менее 10% полной силы) и величина взаимодействия определяется обменным отталкиванием между ближайшими атомами острия и образца [4]. Потенциал таких сил, действующих между отдельными атомами, имеет вид

$$V^{atom}(r) = \frac{\alpha}{r^{12}}, \quad (1)$$

где α – константа обменного взаимодействия, r – расстояние между атомами острия и образца.

Поскольку взаимодействие (1) является короткодействующим, будем считать, что эффективно взаимодействуют только те атомы, которые „касаются” друг друга непосредственно. Как следствие этого, образец можно моделировать только атомами поверхностного слоя. Дефекту же типа вакансии соответствует отсутствие одного такого атома. Ниже предполагается, что наличие дефекта не

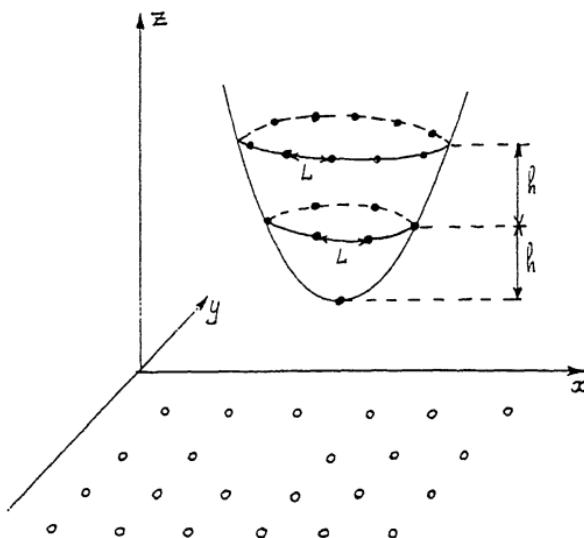


Рис. 1. Схематическое изображение атомов на поверхности острия ACM и образца.

приводит к значительной релаксации решетки и расстояние между близкими к вакансии атомами приблизительно такое же, как и между удаленными (отметим, что если это не так, то методом ACM легко установить фактическую величину межатомных расстояний вблизи дефекта).

При сканировании острия ACM над поверхностью в диапазоне сил отталкивания уже нельзя моделировать острие идеальным параболоидом вращения, как это делалось, например, в работах [2, 3]. Необходимо рассматривать острие как конфигурацию из отдельных атомов, расположенных на поверхности параболоида вращения $z = (x^2 + y^2)/2R + d$, где R – радиус кривизны острия, d – высота острия над плоскостью образца, совпадающей с плоскостью (x, y) (см. рис. 1).

Более детально будем „строить“ поверхность острия из атомов следующим образом. Пусть на кончике острия находится один атом (нулевой слой). Первый слой атомов находится на высоте h над нулевым, где h – расстояние между решеточными плоскостями для кристаллов или просто межатомное расстояние. На такой же высоте над предыдущим находится и каждый следующий слой. Число атомов, расположенных в n -ом слое на поверхности острия, равно

$$N_n = \left[\frac{2\pi\sqrt{2Rh_n}}{L} \right], \quad (2)$$

Рис. 2. Расположение атомов в n -ом поверхностном слое острия АСМ.

где L – характерное расстояние между атомами в слое (для аморфных веществ $L=h$), квадратные скобки означают взятие целой части числа.

Зададим теперь положение атомов на поверхности острия в системе координат x, y, z (рис. 1). Пусть атом n -го слоя

острия, имеющий максимальное значение x , ориентирован под углом φ_n к оси x относительно вертикальной оси, проходящей через вершину острия (см. рис. 2). При разных n углы φ_n , вообще говоря, различны. Для удобства рассмотрим случай, когда атом последующего слоя находится между двумя атомами предыдущего в плоскости (x, y) , т.е. когда, например, $\varphi_2 = \varphi_1 + \pi/N_1$. Как показывают численные расчеты, та или иная фиксация величин φ_n не оказывает сколь-нибудь существенно на качественном поведении линий постоянной силы. Так, для дивакансии (см. ниже) при $N_1 = 6$ переход от $\varphi_1 = 0$ к наибольшему возможному значению $\varphi_1 = \pi/6$ изменяет \geq координату точек на линиях постоянной силы в областях быстрейшего изменения \geq на (10–30)% и практически не изменяет – вблизи экстремумов.

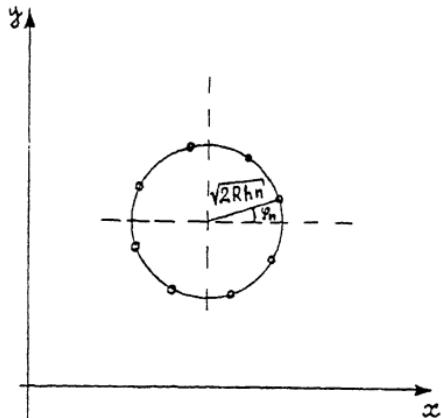
Окончательно для n -го слоя легко получить следующие выражения координат атомов, находящихся на поверхности острия:

$$\begin{aligned} x &= X + \sqrt{2Rhn} \cos \left(\frac{2\pi m}{N_n} + \varphi_n \right), \\ y &= Y + \sqrt{2Rhn} \sin \left(\frac{2\pi m}{N_n} + \varphi_n \right), \\ z &= d + nh, \quad \varphi_n = \varphi_{n-1} + \pi/N_{n-1}, \quad m = 1, \dots, N_n, \end{aligned} \tag{4}$$

где x, y – координаты кончика острия АСМ.

Следует отметить, что указанным алгоритмом можно задать практически любое острие АСМ, имеющее как кристаллическую, так и аморфную структуру, варьируя лишь величины $h, L, \varphi_1, \varphi_2 \dots \varphi_n$.

Подобно [14–16] запишем теперь выражение для силы, возникающей в описанной конфигурации вследствие потенциала (1). Представляющую интерес в методе АСМ проекцию силы отталкивания на ось z можно выразить через частную производную от потенциала (1) по z , просуммировав затем аддитивно полученный результат по атомам поверхностей острия и образца. В итоге получаем:



$$F_z = \alpha \sum_{(x,y,z)} \sum_{(\bar{x},\bar{y},0)} \frac{12z}{r^{14}},$$

где $r^2 = (x - \bar{x})^2 + (y - \bar{y})^2 + z^2$, (x, y, z) – координаты атомов на поверхности острия АСМ, а $(\bar{x}, \bar{y}, 0)$ – координаты атомов поверхности образца. Следует отметить, что в (5) дают заметный вклад лишь те атомы острия и образца, которые находятся в непосредственном контакте. Поэтому здесь, в отличие от [4], где рассматривались непрерывные тела, допустимо формально распространять параметризацию (1) на удаленные атомы.

Теперь можно перейти к моделированию АСМ изображений интересующей нас поверхности. Учитывая тот факт, что АСМ изображение представляет собой набор линий постоянной силы, получим его как результат решения уравнения

$$F_z(x, y, z) = F_0,$$

где $F_z(x, y, z)$ – сила (5), рассматриваемая как функция координат кончика острия АСМ, F_0 – сила, при которой производится сканирование.

Чтобы продемонстрировать возможности метода АСМ, выберем труднообнаруживаемый дефект – единичную вакансию, т.е. отсутствие всего одного атома в узле решетки. Для определенности примем, что межатомное расстояние в решетке и в острие равно 3 Å, начальная высота сканирования $d_0 = 1.5$ Å, сила, при которой производится сканирование, $F_0 = 10^{-8} N$ (это соответствует $\alpha \approx 1.6 \cdot 10^{-7} N \cdot \text{Å}^{13}$), эффективный радиус кривизны острия $R = 5$ Å. Будем проводить сканирование участка поверхности вблизи дефекта вдоль оси x со смещением на 1.5 Å по оси y после каждого прохода. Результаты численного расчета линий постоянной силы приведены на рис. 3, а–в. Как видно из рисунка, характер линий постоянной силы соответствует расположению атомов в решетке. При этом влияние дефекта сказывается практически только при сканировании непосредственно над слоем атомов, содержащих дефект.

Пример единичной вакансией недостаточно полно иллюстрирует развитый формализм, поскольку острие АСМ не опускалось достаточно глубоко в области, где отсутствует атом решетки, так что характер линий постоянной силы фактически определяется взаимодействием с атомами поверхности единственного атома на кончике острия. В качестве другого примера рассмотрим линии постоянной силы при сканировании острия АСМ над дивакансией, т.е. над дефектом, состоящим в отсутствии двух последовательных атомов решетки. Результаты численного расчета по (4)–(6) при тех же значениях параметров, что и для ваканси, приведены на рис. 3, г. Здесь, кроме того, положено $Y_1 = 0$ (как уже отмечалось выше, изменение значения Y_1 не приводит к каким-либо существенным

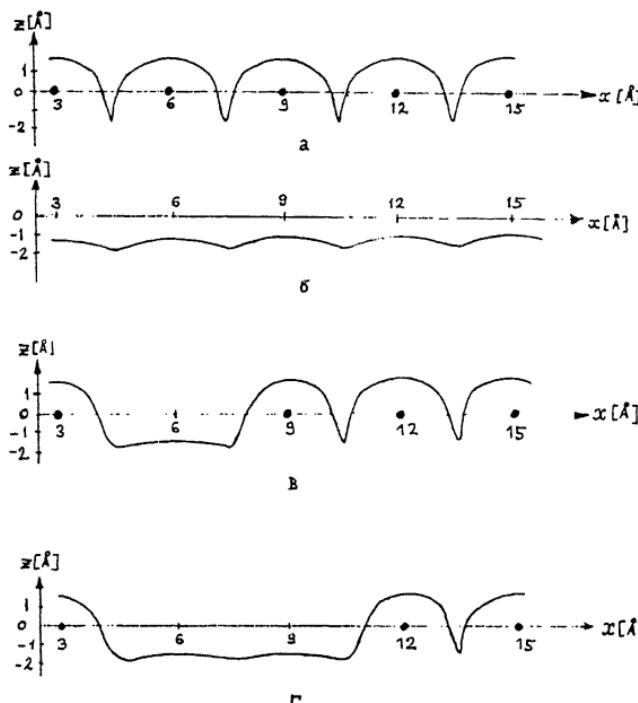


Рис. 3. Линии постоянной силы при сканировании острия АСМ над рядом атомов решетки, не содержащих дефектов (а), между двумя рядами атомов (б), и над рядами, содержащими дефекты типа вакансии при $x = 6 \text{ \AA}$ (в) и дивакансии при $x_1 = 6 \text{ \AA}$, $x_2 = 9 \text{ \AA}$ (г).

отличиям). В данном случае имеет место значительное опускание острия в месте расположения дивакансии и определенный вклад в значение силы (5) вносит взаимодействие атомов решетки с атомами первого слоя на поверхности острия. При сканировании над дивакансией линия постоянной силы четко вопроизводит ее профиль.

Как следует из результатов проведенных модельных расчетов, ACM-изображение надежно фиксирует труднообнаружимые другими методами точечные дефекты. По характеру аномалии на линии постоянной силы над дефектом легко определить его геометрические характеристики, что открывает возможности для диагностики методом ACM свойств практических любых дефектов на поверхности материалов.

С п и с о к л и т е р а т у р ы

- [1] Binning G., Quate C.F., Gerber Ch. // Phys. Rev. Lett. 1986. V. 56. N 9. P. 936.
- [2] Moiseev Yu.N., Mostepanenko V.M., Panov V.I., Sokolov I.Yu. // Phys. Lett. A. 1988. V. 132. N 6, 7. P. 354.

- [3] М о и се е в Ю.Н., М о с т е п а н е н к о В.М., П а-
н о в В.И., С о к о л о в И.Ю. // ЖТФ. 1990. Т. 60.
В. 1. С. 141-148.
- [4] М о и се е в Ю.Н., М о с т е п а н е н к о В.М., П а-
н о в В.И., С о к о л о в И.Ю. // Письма в ЖТФ. 1989.
Т. 15. В. 20. С. 5-11.
- [5] Б л а г о в Е.В., М о и се е в Ю.Н., М о с т е п а н е н-
к о В.М., П а н о в В.И., С о к о л о в И.Ю. // Письма
в ЖТФ. 1991. Т. 17. В. 8. С. 87-90; 1992. Т. 18. В. 18.
С. 30-36.
- [6] З е л е н с к и й В.Ф., Н е к л ю д о в И.М., Ч е р н я-
е в а Т.П. Радиационные дефекты и распухание металлов. Киев:
Наукова думка, 1988. 293 с.
- [7] С у в о р о в А.Л. Автоионная микроскопия радиационных
дефектов в металлах. М.: Энергоатомиздат, 1982. 167 с.
- [8] И н д е н б о м В.Л., Т о ч и л и н С.Б. // Кристаллогра-
фия. 1987. Т. 32. В. 3. С. 586-660; ЖЭТФ. 1990. Т. 98.
В. 4. С. 1402-1411.
- [9] V a n D u s k D. // Micron and Microsc. Acta.
1990. V. 21. N 4. P. 239-242.
- [10] В о р о н к о в С.Н., Ч у х о в с к и й Ф.Н. // Металло-
физика. 1989. Т. 11. В. 6. С. 52-56.
- [11] S i n h a S.K. // Physica B. 1991. V. 174. N 1-
4. P. 499.
- [12] М а с л о в а Н.С., П а н о в В.И. // УФН. 1989. Т. 157.
В. 1.С. 185-195.
- [13] B e h m R.J. // J. Phys.: Cond. Matter. 1991.
Suppl. A-C. P. 117-120.
- [14] B a t r a I.P., C i r a c i S. // J. Vac. Sci. and
Technology. 1988. V. 6. N 2. P. 313-317.
- [15] A b r a h a m F.F., B a t r a I.P. // Surf. Sci.
1989. V. 209. N 1, 2. P. 125-132.
- [16] G i r a r d C., M a g h e z z i S., V a n
L a b e k e D. // Surf. Sci. 1990. V. 234. N 1.
P. 181-196.

Поступило в Редакцию
16 февраля 1993 г.